Numerische Simulation und Messung der Mikrowellenreflexion an kristallinem Silizium

im Fachbereich Physik der Freien Universität Berlin eingereichte Dissertation

> von Olaf Hahneiser

> > 1998

Disputation: 30.06.1998

- 1. Gutachter: Prof. Dr. W. Brewer (FU Berlin)
- 2. Gutachter: Prof. Dr. D. Bräunig (TU Berlin)

Meinen Eltern

Inhaltsverzeichnis

1.	Einle	nleitung1		
2.	Mikrowellenmeßtechnik			
	2.1	Ausbr	eitung der Mikrowellen	
	2.2	Mikro	wellenreflexion	
	2.3	TRM	C-Methode	
	2.4	FRMO	2-Methode	
3.	Siliziumoberfläche 1		rfläche17	
	3.1	Passivierung		
	3.2	Mode	ll der Grenzfläche	
	3.3	Oberf	ächenrekombinationsgeschwindigkeit19	
4.	Simulationsmodell			
	4.1	Halbleiter-Grundgleichungen		
	4.2	4.2 Modellierung des Volumens		
		4.2.1	Optische Generation	
		4.2.2	Volumenrekombination	
4.3 Modellierung der Oberfläche		Mode	lierung der Oberfläche	
		4.3.1	Oberflächenrekombination	
		4.3.2	Ladung der Grenzfläche	
	4.4	4.4 Randbedingungen		
	4.5	Lösen	der Grundgleichungen	
		4.5.1	Existenz und Eindeutigkeit41	
		4.5.2	Skalierung	
		4.5.3	Methode der finiten Differenzen43	
		4.5.4	Lösungsalgorithmus	
	4.6	Wahl	der Parameter	

5.	Meßergebnisse und Diskussion			53
	5.1	n-dotiertes Silizium		53
		5.1.1	TRMC-Messungen	53
		5.1.2	FRMC-Messungen	57
		5.1.3	Echte Lebensdauer	63
		5.1.4	Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit	69
	5.2	p-dotie	ertes Silizium	70
		5.2.1	TRMC-Messungen	70
		5.2.2	FRMC-Messungen	77
6.	Zusa	mmenf	assung	83
7. Anhan		ang		85
	7.1	Literat	turverzeichnis	85
	7.2	Symbo	olverzeichnis	89
	7.3	Danks	agung	93
	7.4	Leben	slauf	94

7.2 Symbolverzeichnis

Hier sind die meisten der verwendeten Symbole tabelliert. Ihre Dimension kann von den gebräuchlichen Einheiten abweichen. So wird z.B. die Dicke L des Siliziums in μ m und nicht in mangegeben.

Symbol	Beschreibung	Dimension
а	Hohlleiterinnenmaß	m
А	Fresnel-Koeffizient	1
a ₁ ,a ₃	Parameter der Zustandsdichte (Oberfläche)	$m^{-2} \cdot J^{-1}$
a ₂	Parameter der Zustandsdichte (Oberfläche)	J
b	Hohlleiterinnenmaß	m
c ₀	Vakuum-Lichtgeschwindigkeit	$m \cdot s^{-1}$
c _n	SRH-Ratenparameter für Elektronen (Volumen)	$m^3 \cdot s^{-1}$
c _p	SRH-Ratenparameter für Löcher (Volumen)	$m^3 \cdot s^{-1}$
c _{SRH}	SRH- Ratenparameter (Volumen)	$m^3 \cdot s^{-1}$
d	Länge der Raumladungszone	m
d	Durchmesser des Laserspots auf der Probe	m
D _n	Diffusionskonstante der Elektronen	$m^2 \cdot s^{-1}$
D _p	Diffusionskonstante der Löcher	$m^2 \cdot s^{-1}$
E	Energie eines Trap-Niveaus	J
Ē	elektrisches Feld	$V \cdot m^{-1}$
E _C	Energie des Leitungsbandes	J
E_{F}	Fermi-Energie im thermodynamischen Gleichgewicht	J
Egap	Energielücke	J
E _n	Quasi-Ferminiveau der Elektronen	J
E _p	Quasi-Ferminiveau der Löcher	J
E _{Ph}	Photonenenergie	J
E _V	Energie des Valenzbandes	J
f	Korrekturfaktor	1
f_0	Fermi-Funktion im thermodynamischen Gleichgewicht	1
f_A	Besetzungsfunktion der Akzeptor-Traps (Oberfläche)	1

f_D	Besetzungsfunktion der Donator-Traps (Oberfläche)	1
f_{T}	Besetzungsfunktion der Volumen-Traps	1
G	optische Generationsrate	$m^{-3} \cdot s^{-1}$
h	Plancksche Wirkungsquantum	J·s
\vec{H}	magnetisches Feld	$A \cdot m^{-1}$
j	(Gesamt-) Strom	$A \cdot m^{-2}$
j _n	Elektronenstrom	$A \cdot m^{-2}$
j _p	Löcherstrom	$A \cdot m^{-2}$
kT	Boltzmann-Faktor	J
L	Dicke des Siliziums	m
m	FRMC-Modulationswert	1
n	Elektronenkonzentration im Leitungsband	m ⁻³
Ν	Zustandsdichte (Oberfläche)	$m^{-2} \cdot J^{-1}$
Ν	Anzahl der Rasterpunkte	1
n ₀	n im thermodynamischen Gleichgewicht	m ⁻³
n ₁	SRH-Abkürzung	m ⁻³
NA	Akzeptor-Zustandsdichte (Oberfläche)	$m^{-2} \cdot J^{-1}$
N _C	effektive Zustandsdichte im Leitungsband	m ⁻³
ND	Donator-Zustandsdichte (Oberfläche)	$m^{-2} \cdot J^{-1}$
N _{dot}	Konzentration der ionisierten Dotieratome	m ⁻³
n _i	intrinsische Ladungsträgerkonzentration	m ⁻³
NT	Zustandsdichte der Volumentraps	m ⁻³
n _{trap}	getrapte Elektronendichte (Oberfläche)	m ⁻²
NV	effektive Zustandsdichte im Valenzband	m ⁻³
р	Löcherkonzentration im Valenzband	m ⁻³
Р	Lichtintensität	$W \cdot m^{-2}$
p ₀	p im thermodynamischen Gleichgewicht	m ⁻³
p ₁	SRH-Abkürzung	m ⁻³
P _{abs}	absorbierte Mikrowellenleistung	W
P _{in}	eingestrahlte Mikrowellenleistung	W
P _{max}	Lichtintensität im Maximum des TRMC-Pulses	$W \cdot m^{-2}$

P _{ref}	reflektierte Mikrowellenleistung	W
p _{trap}	getrapte Löcherdichte (Oberfläche)	m^{-2}
q	Elementarladung	С
Q _{fix}	Dichte der festen Oxid- bzw. Nitridladungen	m^{-2}
ř	Ortsvektor	m
r	Reflexion	1
R	Reflexionsfaktor	1
R	stationäre Rekombinationsrate (Volumen)	$m^{-3} \cdot s^{-1}$
$r_1 \dots r_4$	SRH-Übergangsraten	$m^{-3} \cdot s^{-1}$
R _n	Rekombinationsrate der Elektronen (Volumen)	$m^{-3} \cdot s^{-1}$
R _p	Rekombinationsrate der Löcher (Volumen)	$\mathrm{m}^{-3}\cdot\mathrm{s}^{-1}$
R ^S	stationäre Rekombinationsrate (Oberfläche)	$m^{-2} \cdot s^{-1}$
R^{vol}	Volumenrekombinationsrate (räumlich gemittelt)	$m^{-3} \cdot s^{-1}$
R_n^S	Rekombinationsrate der Elektronen (Oberfläche)	$m^{-2} \cdot s^{-1}$
R_p^S	Rekombinationsrate der Löcher (Oberfläche)	$m^{-2} \cdot s^{-1}$
S	Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit	$m \cdot s^{-1}$
s [*]	effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit	$m \cdot s^{-1}$
ĩ	differentielle Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit	$m \cdot s^{-1}$
t	Zeit	S
U	gesamte Rekombinationsrate (räumlich gemittelt)	$m^{-3} \cdot s^{-1}$
U	Spannung	V
U _{Ph}	Photospannung	V
U^{S}	virtuelle Oberflächenrekombinationsrate	$m^{-2} \cdot s^{-1}$
x, y, z	Komponenten des Ortsvektors r	m
α	Absorptionskoeffizient	m^{-1}
α	Iterationsindex	1
δ _c	SRH-Ratenparameter geladener Übergänge (Oberfläche)	$m^3 \cdot s^{-1}$
δ_n	SRH-Ratenparameter neutraler Übergänge (Oberfläche)	$m^3 \cdot s^{-1}$
Δn	Überschußkonzentration der freien Elektronen	m^{-3}
Δp	Überschußkonzentration der freien Löcher	m^{-3}
Δσ	Photoleitfähigkeit	$(\Omega \cdot m)^{-1}$

Δt	Zeitintervall	S
ϵ_0	elektrische Feldkonstante	$C/(V \cdot m)$
ε _r	relative Dielektrizitätskonstante	1
φ	Photonenflußdichte	$m^{-2} \cdot s^{-1}$
γ	Ausbreitungskonstante	m^{-1}
Г	Reflexionskoeffizient	1
λ	Lichtwellenlänge	m
λ	Hohlleiterwellenlänge	m
μ_0	magnetische Feldkonstante	$V \cdot s / (A \cdot m)$
μ_n	Beweglichkeit der Elektronen	$m^2/(V \cdot s)$
μ_{p}	Beweglichkeit der Löcher	$m^2/(V \cdot s)$
ν	Mikrowellenfrequenz	s^{-1}
ν	FRMC-Modulationsfrequenz	s^{-1}
ρ	Ladungsdichte	$C \cdot m^{-3}$
ρ	spezifischer Widerstand	$\Omega \cdot m$
σ	Grenzflächenladung	$C \cdot m^{-2}$
σ	Leitfähigkeit	$(\Omega \cdot m)^{-1}$
τ	echte Lebensdauer	S
τ_{eff}	effektive Lebensdauer	S
$\boldsymbol{\tau}_n$	SRH-Lebensdauer der Elektronen (Volumen)	S
τ_{p}	SRH-Lebensdauer der Löcher (Volumen)	S
$\tau_{\rm S}$	Oberflächenlebensdauer	S
$ au_{SRH}$	SRH-Lebensdauer (Volumen)	S
τ_{vol}	Volumenlebensdauer	S
$ au^*$	differentielle Lebensdauer	S
Ψ	elektrisches Potential	V
$\Psi_{\rm S}$	Oberflächenbandverbiegung	V

7.3 Danksagung

Zum Gelingen der Dissertation, die für den Verfasser ein großer, für die Menschheit jedoch nur ein kleiner Schritt ist, haben mehrere Personen beigetragen. Ihnen sei an dieser Stelle gedankt.

Die Betreuung dieser Arbeit wurde in der Endphase von Dr. Marinus Kunst übernommen. Die wissenschaftlichen Diskussionen in entspannter Atmosphäre waren unentbehrlich. Marinus, vielen Dank!

Dr. L. Elstner stand mir für Fragen, die im Rahmen der Programmentwicklung auftraten, stets zur Seite.

Prof. Dr. W. Brewer und Prof. Dr. D. Bräunig sei für die Bereitschaft gedankt, sich als Gutachter und Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, noch bevor von dieser Arbeit auch nur eine einzige Zeile geschrieben war.

Die Präparation der Proben wurde von G. Keiler, R. Boelke, B. Rabe, D. Patzek und J. Krause übernommen. Die CV- und SPV- Charakterisierungen führten B. Steudel und Dr. K. Kliefoth aus der Arbeitsgruppe von Dr. W. Füssel durch.

Dr. Rainer Eichberger und Herbert Moegelin waren mir beim Verändern des FRMC-Meßplatzes behilflich.

Das inhaltliche Korrekturlesen des vierten Kapitels übernahm Dr. Rudi Brüggemann.

Auf die Suche nach Rechtschreibfehlern begaben sich Silke Uhlmann, Torsten Rentel und Christian Meißner. Dies gibt dem Verfasser die Möglichkeit, auf sie zu verweisen, falls nicht alle Fehler beseitigt sein sollten.

Zwei Sätze werden mir sicherlich in Erinnerung bleiben. Der eine stammt von Prof. Dr. W. Brewer, als mich wissenschaftliche Zweifel überkamen: "Herr Hahneiser, dort ist etwas, wir müssen es nur finden." Der andere stammt von Dr. Hubert Vogler beim Genuß eines Traubensaftes (hell und vergoren): "Es gibt ein Leben nach der Promotion."

7.4 Lebenslauf

07.07.1968	geboren in Krefeld-Uerdingen
09/1974 - 06/1987	Schulzeit in Berlin (Abschluß: Abitur)
10/1987	Beginn des Physikstudiums an der FU Berlin
01/1993 - 12/1993	Diplomarbeit bei Siemens (Medizintechnik) in Erlangen
	Thema: Entwicklung und Erprobung einer SQUID-Sensor-
	anordnung zur Messung biomagnetischer Felder
04/1994	Beendigung des Studiums an der FU Berlin (Abschluß: Diplom)
10/1994 - 03/1998	Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hahn-Meitner-Institut
	in Berlin-Adlershof und Berlin-Wannsee